

非接触ナノ形状測定法における 系統誤差シミュレーション

大阪大学 工学研究科 氏名 木崎 嶺

目的 形状自由度の高い光学素子の形状測定を行う装置の
開発及びその改善

内容 光学素子の形状誤差を測定するために、光学素子の
各点の法線ベクトルを取得し形状誤差を導出する。

結果 R=1000 mm凹球面ミラーの測定において、得られたデー
タを冪級数10次、フーリエ級数50次で導出。その後、
装置の系統誤差をフィッティングで除去している。

利用した計算機
ノード時間
使用メモリ

SX-ACE
0時間
23GB

